

小型排気装置

1. 概要

- 本装置は、高真空に排気を行い、真空気密部品を製作するための装置です。

主に次のような用途に適しています。

- ①真空が必要な部品の実験,試作,少量生産。
- ②真空または不活性ガスを封入する各種センサの実験,試作,少量生産。

2. 設備仕様

2. 1 寸法(単位:mm)

本体 : 1180(W) × 770(D) × 1980(h)
制御架台 : 540(W) × 780(D) × 1595(h)

2. 2 重量

本体 : 約740(Kg)
制御架台 : 約160(Kg)

2. 3 用力

電源 : AC200(V) 1φ 50/60(Hz) 1系統
最大40(A) (通常使用時約14(A))

2. 4 構成・構造

2. 4. 1 主真空系

ターボ分子ポンプ、ロータリーポンプを使用した排気系

2. 4. 2 ガス導入系

1系統(ただし、不活性ガスのみ)

2. 4. 3 オープン

- ①ヒーター容量 : 200(V) 2(kw)
- ②最高温度 : 200(°C)
- ③温度制御範囲 : ±5(°C)

2. 4. 4 アダプターニップル

被排気物10(個)取付け可能

2. 4. 5 フレーム架台

主排気系、ガス導入系を納めた架台

2. 4. 6 制御架台

制御系を納めた架台

2.5 真空性能

①到達真空度

ベーキング後、排気ニップル部で 10^{-7} (Pa)台

②排気時間

ターボ分子ポンプ立ち上がり後、15分で 3×10^{-4} (Pa)
(ベーキング後、排気ニップル部)

③リーク量

6.7×10^{-11} (Pa·m³/sec)以下 (ICFフランジ側)

1.3×10^{-8} (Pa·m³/sec)以下 (Oリング、NW25側)

ただし、“O”リングのガス透過は除く

2.6 主な機器仕様

①ターボ分子ポンプ

島津製作所製 TMP-303M (排気量320L/s)

②ロータリーポンプ

アルカテル製 M2015SD (排気量250L/min)

③記録計

チノー製 3ペンハイブリッド記録計

AL373P-N00-00A (100mmチャート)

④カレンダータイマー

オムロン製 デジタルウィークリータイムスイッチ

H5S-A-31

⑤プログラム温調計

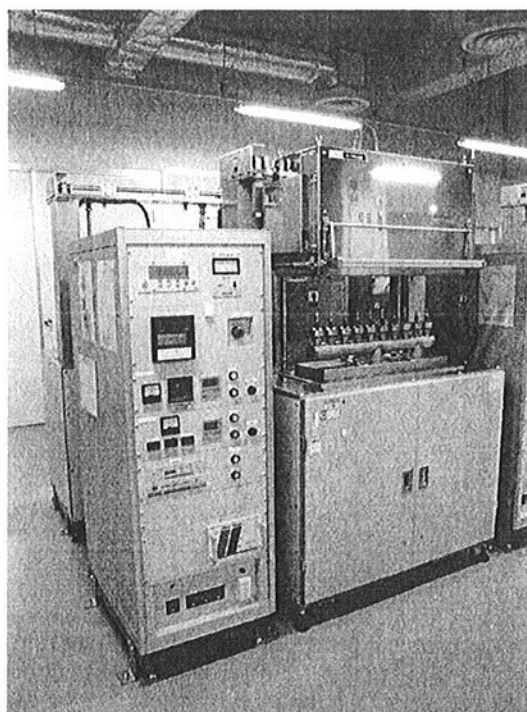
チノー製 デジタルプログラム温調計

KP1130B008

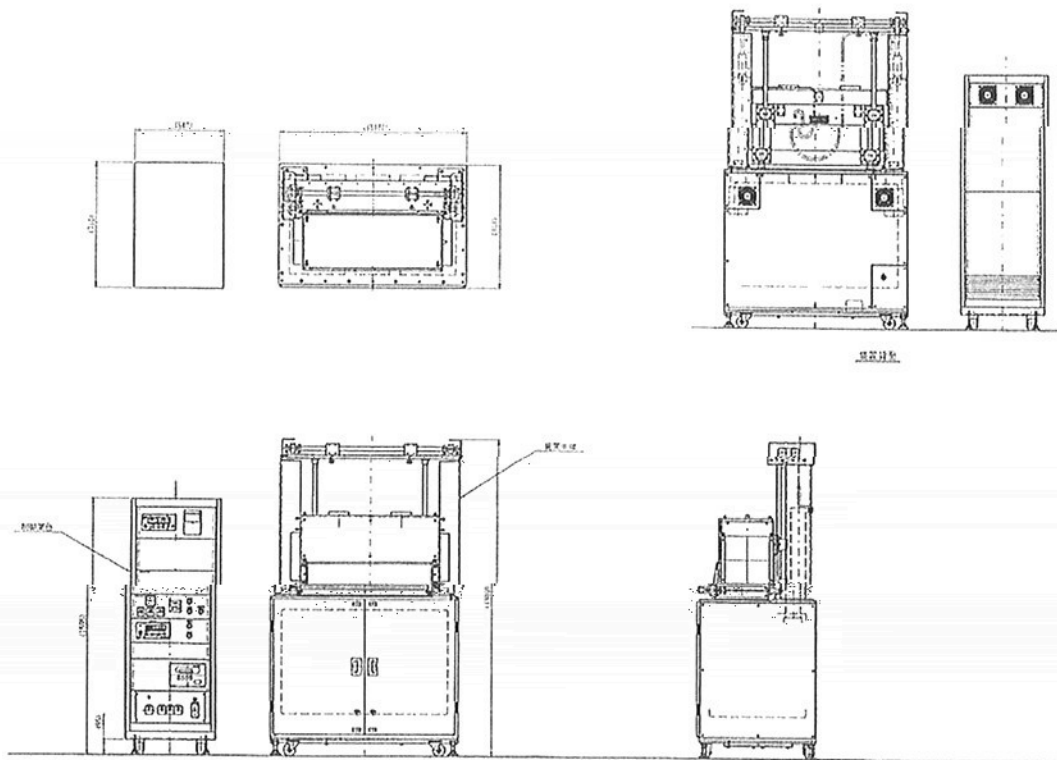
2. 7 製造メーカー

キヤノンアネルバテクニクス(株)

3. 外観



4. 外観図



5. 排気系統図

